格子不整合サファイア基板上への単結晶 ZnO 膜のスパッタリング成膜: ZnON バッファー層の効果

Growth of single-crystalline ZnO films on lattice-mismatched sapphire substrates by RF magnetron sputtering using ZnON buffer layers

九大シ情 ¹,自然科学研究機構 ², ^O三石遼 ¹, 矢高功太郎 ¹, 山下尚人 ¹, 奥村賢直 ¹, 鎌滝晋礼 ¹, 古閑一憲 ^{1,2}, 白谷正治 ¹, 板垣奈穂 ¹

Kyushu Univ.¹, NINS², °R. Mitsuishi¹, K. Yataka¹, N. Yamashita¹, T. Okumura¹, K. Kamataki¹, K. Koga^{1,2}, M. Shiratani¹, N. Itagaki¹

E-mail: r.mitsuishi@plasma.ed.kyushu-u.ac.jp

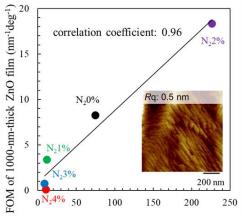
ZnO は 60 meV の高い励起子束縛エネルギーを有し、励起子トランジスタなど次世代光電子デバイスへの応用が期待されている。最近我々は、ZnON バッファー層を用いることで、18%もの格子不整合率を有するサファイア基板上への単結晶膜成長に成功した [1,2]。上記バッファー層は高配向・超平坦ナノ結晶粒からなり、高密度に導入された粒界が格子不整合に起因した歪エネルギーを解放し、転移発生を伴わない格子緩和をもたらしたと考えられる。このような超微小結晶粒の作製は従来困難であったが、非固溶系の不純物である窒素を導入し表面エネルギーを制御することでこれを実現した [1]。本研究では、ZnO 膜の更なる高品質化を目指し、ZnON バッファー層作製時の N_2 導入量が最終的に形成される単結晶 ZnO 膜の表面モフォロジーと結晶品質に及ぼす影響を調べたので報告する。

全ての膜をマグネトロンスパッタリング法により作製した. まず膜厚 10~nm の ZnON バッファー層を Ar/N_2 雰囲気中,基板温度 780° C にて作製した. N_2 流量比 (FR_{N2}) は 0–4%とした. 次に,ZnON バッファー層上に膜厚 1000~nm の ZnO 膜を Ar/O_2 雰囲気中,基板温度 800° C にて作製した.

バッファー層形成時の N_2 流量比は 2% に最適値があり,このとき形成された単結晶 ZnO 膜は単原子層ステップ表面を有することが確認された(図 1 挿入図). (002) 面ロッキングカーブ半値幅 (FWHM $_{002}$) と二乗平均平方根粗さ(R_q) はそれぞれ 0.02° および $0.5\,\mathrm{nm}$ であり,サファイア基板直上に作製した ZnO 膜 (FWHM $_{002}=0.05^\circ$, $R_q=12.6\,\mathrm{nm}$)と比べると,バッファー層導入が結晶品質の向上に極めて有効であることが分かる.この効果は,しかし $FR_{N2}\geq 3\%$ の領域で低下し, $FR_{N2}=3\%$ で R_q は $5.3\,\mathrm{nm}$ の値を示した.バッファー層自体の R_q は FR_{N2} に依存せず一定の値を示したことから,膜中に欠

陥として取り込まれた過剰 N 原子が面内・面外配向性を低下させ、ZnO 層の 3 次元的な成長を誘発したことで、平坦性が低下したと考えられる。この影響を定量的に議論するため、ZnO 膜の性能指数(FOM)をその R_q と $FWHM_{002}$ の積の逆数として定義し、これをバッファー層の R_q と $FWHM_{002}$ ならびに $FWHM_{101}$ の積の逆数に対してプロットした(図 1)。相関係数 0.96 の非常に強い正の相関が見られ、これは、個々のパラメータに対する相関と比べて顕著に高い値であった。以上の結果は、ZnO 膜の品質が、バッファー層の配向性や表面粗さが複合的に影響を及ぼし合って決定づけられることを示す。本研究の一部は JSPS 科研費 JP21H01372、JP21K18731、JP22H05000 の助成を受けた。

- [1] N. Itagaki, et al., Sci. Rep. 10, 4669 (2020).
- [2] Y. Nakamura, et al., Cryst. Growth Des. (2022).



[$R_q \cdot \text{FWHM}_{002} \cdot \text{FWHM}_{101}$]-1 of buffer (nm⁻¹deg⁻²)

Fig. 1. FOM of ZnO films v.s. reciprocal of the product of R_q , FWHM₀₀₂ and FWHM₁₀₁ of the buffer layers. Inset shows the AFM image of the ZnO film on the buffer fabricated at FR_{N2} = 2% .